

上海建桥学院教学进度安排表

2012 ~ 2013 学年度第 一 学期

课程名称：薄膜技术

班级：微电子10专科

总学时：32

日期	周次 星期	课 程 内 容			授课 方式	上课 地点	作业 布置
		章	节	内 容			
9-4	1/二	1	1	绪言	讲课	1363	
9-6	1/四	2	1-3	薄膜制备的真空技术基础	讲课	1363	5 题
9-11	2/二	2-3	4/1	真空测定 真空蒸发物理基础	讲课	1363	
9-13	2/四	3	2-3	淀积膜厚度均匀性和纯度 电阻式蒸发法	讲课	1363	6 题
9-18	3/二	3	4-5	电子束蒸发法 激光蒸发法	讲课	1363	
9-20	3/四	4	1-2	溅射物理基础 溅射现象和特性	讲课	1363	6 题
9-25	4/二	4	3-4	直流溅射 三极溅射	讲课	1363	
9-27	4/四	4	5-7	射频溅射 磁控溅射 反应性溅射	讲课	1363	
10-2	5/二			国庆节放假			
10-4	5/四			国庆节放假			
10-9	6/二	5	1-2	CVD 基本过程 常用膜物质获得途径	讲课	1363	8 题
10-11	6/四	5	3-5	CVD 基本过程 CVD 条件 CVD 装置简介	讲课	1363	
10-16	7/二	5	6-8	CVD 基本工艺 APCVD LPCVD	讲课	1363	
10-18	7/四	5	9-11	DECVD PCVD MOCVD	讲课	1363	
10-23	8/二	6	1-2	外延生长概述 化学气相外延基本工艺	讲课	1363	4 题
10-25	8/四	6	3-5	外延膜形成机理 影响外延层质量因素 CVD 与 CVD 比较	讲课	1363	
10-30	9/二			总复习	复习	1363	

11-1	9/四			考试	习题课	1363	
------	-----	--	--	----	-----	------	--

注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：顾永明
日期：2012.8.31

系主任审核：
日期：

教学院长审核：
日期：